



CAS IR Grid / 微电子研究所 / 中国科学院微电子研究所 / 微电子器件与集成技术重点实验室

## 高精度微纳结构掩模制造核心技术

文献类型: 成果

热门

**作者** 刘明<sup>1</sup>; 谢常青<sup>1</sup>; 叶甜春<sup>1</sup>; 陈宝钦<sup>1</sup>; 卞福良; 龙世兵<sup>1</sup>

**获奖日期** 2014

**文献子类** 国家技术发明奖

**奖励等级** 二等奖

**语种** 中文

**源URL** [http://159.226.55.106/handle/172511/18479]

**专题** 微电子研究所\_微电子器件与集成技术重点实验室

**作者单位** 中国科学院微电子研究所

**推荐引用方式** 刘明,谢常青,叶甜春,等. 高精度微纳结构掩模制造核心技术. . 2014.

**GB/T 7714**

入库方式: OAI收割

来源: [微电子研究所](#)

浏览	下载	收藏
142	0	0

其他版本

除非特别说明, 本系统中所有内容都受版权保护, 并保留所有权利。